## 9日本国特許庁(JP)

## ①実用新案出顧公開

# ④ 公開実用新案公報(U) 昭60-116239

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和60年(1985)8月6日

H 01 L 21/60 23/34

21/60 6732-5F 23/34 6616-5F 29/78 8422-5F

審査請求 未請求 (全2頁)

❷考案の名称

パワーMOSFETの実装構造

②実 願 昭59-2858

**会出 顧昭59(1984)1月12日** 

砂考 案 者

保

横須賀市夏島町1番地 日産自動車株式会社追兵工場内

砂考案者 高 辻

吉 明

東京都大田区大森西5丁目28番6号 ナイルス部品株式会

社内

⑪出 願 人 日産自動車株式会社

富

永

横浜市神奈川区宝町2番地

⑪出 願 人 ナ

ナイルス部品株式会社

東京都大田区大森西5丁目28番6号

砂代 理 人 身

弁理士 和田 成則

#### 砂実用新案登録請求の範囲

半導体基体の1主面をドレインとし、他の主面にゲートとソースを形成する縦型パワー MOSFETにおいて:

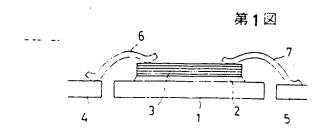
前記ゲート、ソースが形成されている領域面上に、絶縁層を介してソース配線層を形成するとともに、該ソース配線層上には金属片を接着し、該金属片とリードフレームとの間をワイヤボンデイングで接続することを特徴とするパワーMOSFETの実装構造。

#### 図面の簡単な説明

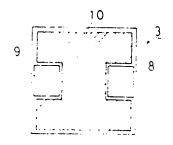
第1図は従来の実装構造を示す断面図、第2図

は同平面図、第3図は同素子断面図、第4図は本 考案に係わるパワーMOSチップの素子断面図、 第5図は同平面図、第6図は本考案に係わる実装 構造の断面図である。

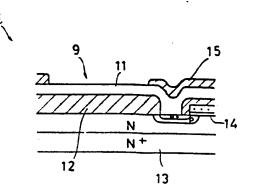
13…ドレイン層、14…ゲートSiO₂膜、16…パワーMOSチップ、17…ソース領域、18…ゲート層、19…絶緑層、20…ソース配線層、21…ゲートパツド、22…素子形成領域、23…ドレイン側の放熱板、25…軟ろう材または導電性接着剤、26…金属片、27…ソース電極となるリードフレーム、28…細線、29…ゲース電極となるリードフレーム、30…細線。



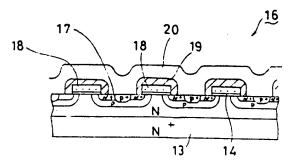
第 2 図

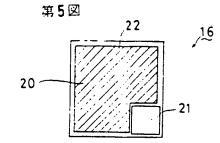


# 第3図



第4図





第6図

